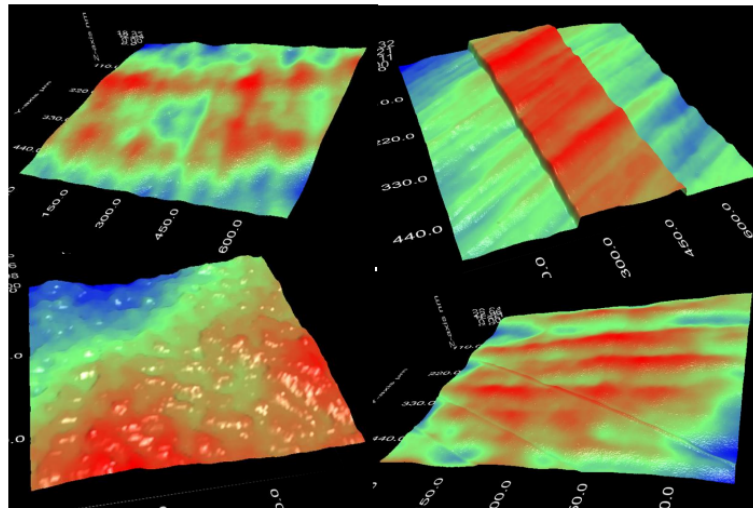


欧洲轮廓仪国内代理

生成日期: 2025-10-21

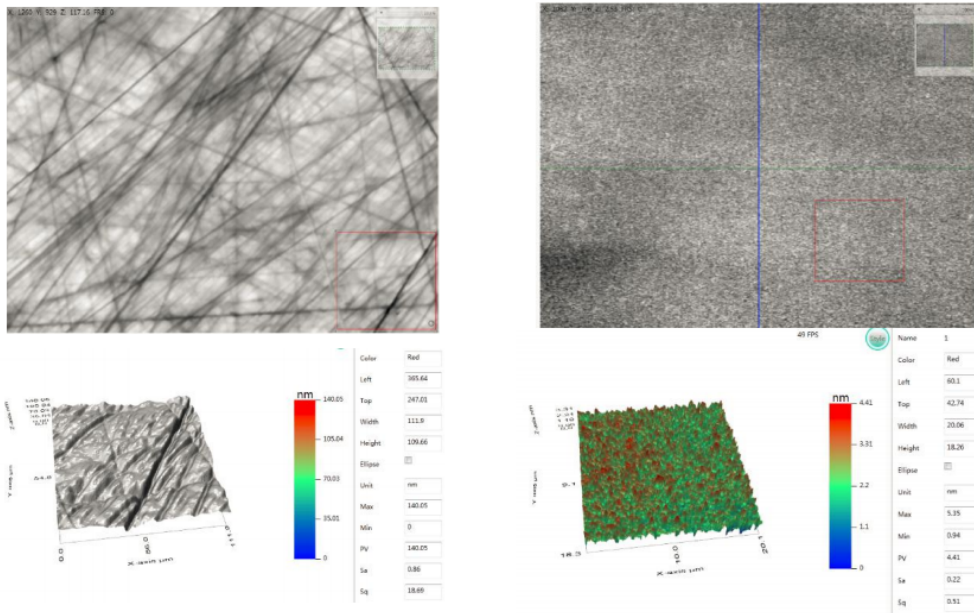
2) 共聚焦显微镜方法共聚焦显微镜包括LED光源、旋转多真孔盘、带有压电驱动器的物镜和CCD相机。LED光源通过多真孔盘(MPD)和物镜聚焦到样品表面上,从而反射光。反射光通过MPD的真孔减小到聚焦的部分落在CCD相机上。传统光学显微镜的图像包含清晰和模糊的细节,但是在共焦图像中,通过多真孔盘的操作滤除模糊细节(未聚焦),只有来自聚焦平面的光到达CCD相机。因此,共聚焦显微镜能够在纳米范围内获得高分辨率。每个共焦图像是通过样品的形貌的水平切片,在不同的焦点高度捕获图像产生这样的图像的堆叠,共聚焦显微镜通过压电驱动器和物镜的精确垂直位移来实现。200到400个共焦图像通常在几秒内被捕获,之后软件从共焦图像的堆栈重建精确的三维高度图像。白光干涉系统基于无限远显微镜系统,通过干涉物镜产生干涉条纹,使基本的光学显微镜系统变为白光干涉仪。欧洲轮廓仪国内代理

超精密表面缺陷分析,核探测



表面缺陷分析,表面粗糙度分析

轮廓仪产品概述 NanoX-2000/3000系列3D光学干涉轮廓仪建立在移相干涉测量(PSI)白光垂直扫描干涉测量(VSI)和单色光垂直扫描干涉测量(CSI)等技术的基础上,以其纳米级测量准确度和重复性(稳定性)定量地反映出被测件的表面粗糙度、表面轮廓、台阶高度、关键部位的尺寸及其形貌特征等。广泛应用于集成电路制造(MEMS)航空航天、精密加工、表面工程技术、材料、太阳能电池技术等领域。想要了解更多的信息,请联系我们岱美仪器。欧洲轮廓仪国内代理光学系统:同轴照明无限远干涉成像系统。



轮廓仪的性能测量模式移相干涉[PSI]白光垂直扫描干涉[VSI]单色光垂直扫描干涉[CSI]样品台150mm/200mm/300mm样品台（可选配[XY]平移 $\pm 25\text{mm}/150\text{mm}/200\text{mm}/300\text{mm}$ 倾斜： $\pm 5^\circ$ 可选手动/电动样品台CCD相机像素标配：1280 \times 960视场范围560 \times 750 μm [10 \times 物镜]具体视场范围取决于所配物镜及CCD相机光学系统同轴照明无限远干涉成像系统光源高效LEDZ方向聚焦80mm手动聚焦（可选电动聚焦[Z]方向扫描范围精密PZT扫描（可选择高精机械扫描，拓展达10mm）纵向分辨率0.1nmRMS重复性*0.005nm[1 σ 台阶测量]**准确度 $\leq 0.75\%$ ；重复性 $\leq 0.1\%$ ，1 σ 横向分辨率 $\geq 0.35\mu\text{m}$ [100倍物镜]检测速度 $\leq 35\mu\text{m}/\text{sec}$ ，与所选的CCD

NanoX-系列产品PCB测量应用测试案例测量种类■基板ASoldMask3D形貌、尺寸■基板ASoldMask粗糙度■基板A绿油区域3D形貌■基板A绿油区域Pad粗糙度■基板A绿油区域粗糙度■基板A绿油区域pad宽度■基板ATrace3D形貌和尺寸■基板B背面PadNanoX-8000系统主要性能▪菜单式系统设置，一键式操作，自动数据存储▪一键式系统校准▪支持连接MES系统，数据可导入SPC■具备异常报警，急停等功能，报警信息可储存■MTBF $\geq 1500\text{hrs}$ ■产能:45s/点（移动+聚焦+测量）（扫描范围50 μm ）>具备Globalalignment&Unitalignment>自动聚焦范围 $\pm 0.3\text{mm}$ >XY运动速度最快晶圆的IC制造过程可简单看作是将光罩上的电路图通过UV刻蚀到镀膜和感光层后的硅晶圆上这一过程。

Profilm3D

轮廓仪



轮廓仪、粗糙度仪、三坐标的区别：关于轮廓仪和粗糙度仪轮廓仪与粗糙度仪不是同一种产品，轮廓仪主要功能是测量零件表面的轮廓形状，比如：汽车零件中的沟槽的槽深、槽宽、倒角（包括倒角位置、倒角尺寸、角度等），圆柱表面素线的直线度等参数。总之，轮廓仪反映的是零件的宏观轮廓。粗糙度仪的功能是测量零件表面的磨加工/精车加工工序的表面加工质量，通俗地讲，就是零件表面加工得光不光（粗糙度老国标叫光洁度），即粗糙度反映的是零件加工表面的微观情况。但是，轮廓仪和粗糙度仪关系其实挺密切，现在有一种仪器叫做粗糙度轮廓测量一体机，就是在轮廓仪上加装了粗糙度测量模块，这样既可以测量轮廓尺寸，又可以测量粗糙度，市场上典型产品就是中图仪器的SJ5701粗糙度轮廓仪。在结构上，轮廓仪基本上都是台式的，而粗糙度仪以手持式的居多，当然也有台式的。共聚焦显微镜包括LED光源、旋转多珍孔盘、带有压电驱动器的物镜和CCD相机。欧洲轮廓仪国内代理

包含了从纳米到微米级别的轮廓、线粗糙度、面粗糙度等二维、三维参数，作为评定该物件是否合格的标准。欧洲轮廓仪国内代理

比较椭圆偏振仪和光谱反射仪光谱椭圆偏振仪(SE)和光谱反射仪(SR)都是利用分析反射光确定电介质，半导体，和金属薄膜的厚度和折射率。两者的主要区别在于椭偏仪测量小角度从薄膜反射的光，而光谱反射仪测量从薄膜垂直反射的光。获取反射光谱指南入射光角度的不同造成两种技术在成本，复杂度，和测量能力上的不同。由于椭偏仪的光从一个角度入射，所以一定要分析反射光的偏振和强度，使得椭偏仪对超薄和复杂的薄膜堆有较强的测量能力。然而，偏振分析意味着需要昂贵的精密移动光学仪器。光谱反射仪测量的是垂直光，它忽略偏振效应（绝大多数薄膜都是旋转对称）。因为不涉及任何移动设备，光谱反射仪成为简单低成本的仪器。光谱反射仪可以很容易整合加入更强大透光率分析。从下面表格可以看出，光谱反射仪通常是薄膜厚度超过10um的手选，而椭偏仪侧重薄于10nm的膜厚。在10nm到10um厚度之间，两种技术都可用。而且具有快速，简便，成本低特点的光谱反射仪通常是更好的选择。光谱反射率光谱椭圆偏振仪厚度测量范围1nm-1mm(非金属)-50nm(金属)*-(非金属)-50nm(金属)测量折射率的厚度要求>20nm(非金属)5nm-50nm(金属)>5nm(非金属)>。欧洲轮廓仪国内代理

岱美仪器技术服务（上海）有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工打造良好的办公环境。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展EVG,Filmetrics, MicroSense, Herz, Herzan, Film Sense, Polytechnik, 4D, Nanotronics, Subnano, Bruker, FSM, SHB的品牌。公司坚持以客户为中心、磁记录、半导体、光通讯生产及测试仪器的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易、转口

贸易，商务信息咨询服务 市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。岱美仪器技术服务（上海）有限公司主营业务涵盖半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。